

平行光両面露光装置

HTE-5102S

両面順次露光方式



株式会社 ハイテック

H T E - 5 1 0 2 S

平行光両面露光装置

本装置は、極めて高精度のパターン再現性を要求される、両面プリント配線の露光用として設計された、コリメーションミラータイプの紫外線平行光露光装置です。

本装置は、高輝度点光源の超高圧水銀灯を光源として、高精度の光学系を構成することにより、レジストの感光域に適合した紫外線を、極めて良好な平行光として照射する光源照射部とバキューム吸着式露光焼枠部（2枠）より構成されています。

***** 仕 様 *****

光源照射部

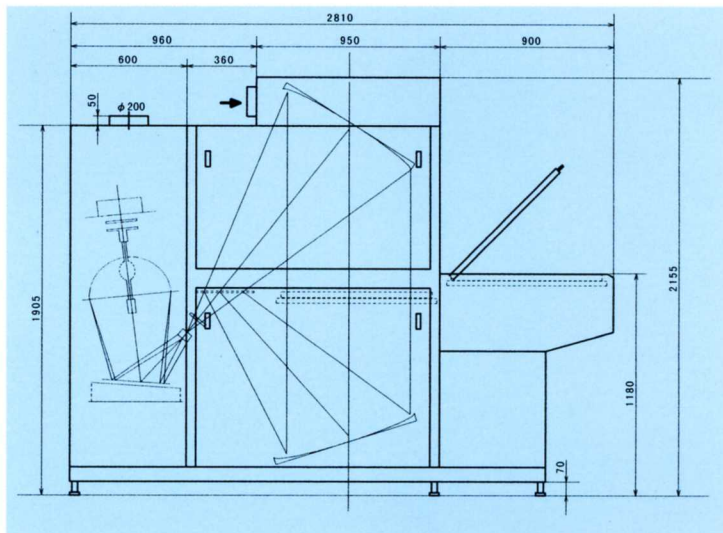
- 光源 : キセノンマージョークランプ 5 kW (空冷方式)
 光学系 : ランプ光軸調整機構
 楕円集光鏡 (UV コールド) $\phi 450$ mm
 第一反射鏡 (UV 反射 IR 透過)
 インテグレートレンズユニット 5×5 (25個) 石英ガラス

光学性能

- 主波長 : 365 nm 405 nm 436 nm
 平行光 : 1.5° 以下 (HALF ANGLE)
 デクリネーション : 1.5° 以下
 エネルギー強度 : 約 12 mW / cm² の 365 nm センサー (初期値)
 エネルギー分布 : 85% 以上

露光焼枠部

- 露光面積 : 610 × 610 mm
 焼枠 : 上面マイラー } × 2 枠
 下面ガラス }
 露光管理 : 積算光量計 2 台
 露光方式 : 両面順次露光
 圧気 : 5 kg / cm²
 重量 : 約 1200 kg
 電源 : 3相 200V
 60A 50/60Hz



外形図

株式会社 ハイテック
 HI-TECH CO.,LTD.

本社 〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-12-6
 TEL 0422-49-8711
 FAX 0422-49-9077

3-12-6 SHIMORENJAKU
 MITAKA-CITY TOKYO 〒181 JAPAN

E-mail: office@hitech-jp.com

URL : http://www.hitech-jp.com